

Registrierung

Bitte registrieren Sie sich online auf der Webseite:

www.cismst.de/anmeldung-mems-2019

Die Anmeldegebühr beträgt **150 Euro** inklusive Mehrwertsteuer. Die gesamte Korrespondenz zum Workshop richten Sie bitte an folgende Adresse:

Veranstaltungsbüro

Uta Neuhaus

CiS e.V.

Konrad-Zuse-Str. 14, 99099 Erfurt, Germany

Phone: +49 361 663 1154

Fax: +49 361 663 1413

E-Mail: veranstaltung@cismst.de

URL: www.cismst.de

Bitte überweisen Sie die Anmeldegebühr von insgesamt **150 Euro**, einschließlich Mehrwertsteuer auf folgendes Konto:

CiS e.V.

Name der Bank: Sparkasse Mittelthüringen

IBAN: DE37 8205 1000 0130 1134 25

BIC: HELADEF1WEM

Verwendung: MEMS Workshop 2019

Hotelempfehlungen in Erfurt:

Mercure Hotel Erfurt Altstadt

Meienbergstraße 26-27, 99084 Erfurt

www.mercure.com/en/hotel-5375-mercure-hotel-erfurt-altstadt/room.shtml

Radisson Blu Erfurt

Juri-Gagarin-Ring 127, 99084 Erfurt

www.radisson-erfurt.de/en/

Ibis Erfurt Altstadt Hotel

Barfuesserstrasse 9, 99084 Erfurt

www.accorhotels.com/gb/hotel-1648-ibis-erfurt-altstadt/index.shtml

Reiseinformationen

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

Konrad-Zuse-Str. 14, 99099 Erfurt, Germany

Sie reisen nach Erfurt ...

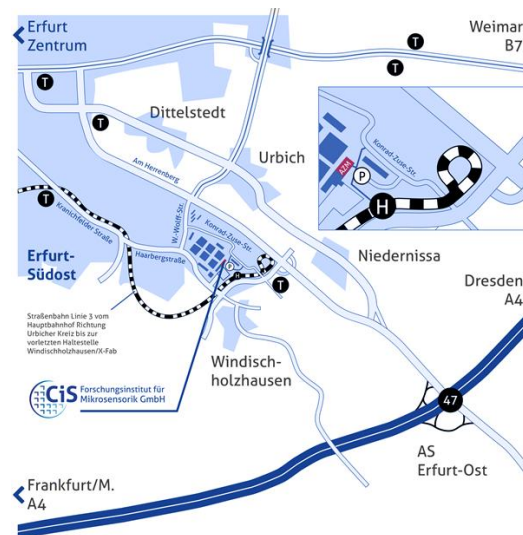
...mit dem **Flugzeug** via Frankfurt oder Berlin

...mit dem **Auto** via Autobahn A4, Ausfahrt "Erfurt Ost"

...mit dem **Zug** zum Erfurter Hauptbahnhof und dann **Straßenbahn** (Nummer 3, Richtung "Urbicher Kreuz", bis Haltestelle "Windischholzhausen/X-Fab") bis zum CiS Forschungsinstitut.



Der Workshop findet im Konferenzraum, 3. Etage statt.



Maßgeschneiderte MEMS-Sensoren für Anwendungen in Wissenschaft, Industrie 4.0, Automotive und Mobilität

Dienstag, 21. Mai 2019

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH



Veranstalter: CiS e.V.

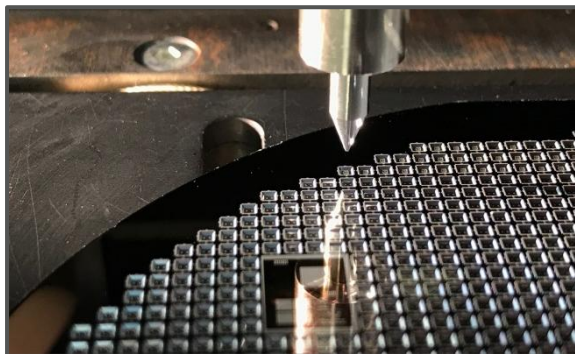


Über den Workshop

Micro-Electro-Mechanical Systems sind Bestandteil vieler Alltagsprodukte. Meist bestehen sie aus Silizium, sind winzig und Basis innovativer Lösungen in der Elektronik. Preiswerte und energiesparende MEMS bilden eine Komponente wirtschaftlicher Applikationen. Im Workshop werden neue Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt und Trends aufgegriffen.

Die Einsatzgebiete von MEMS basierten Sensoren sind breit gefächert und erstrecken sich von Sensoren für die Überwachung von Industrieanlagen, über medizinische Anwendungen bis zu Sensorlösungen für die Mobilität und im Consumer Bereich sowie in der Wissenschaft.

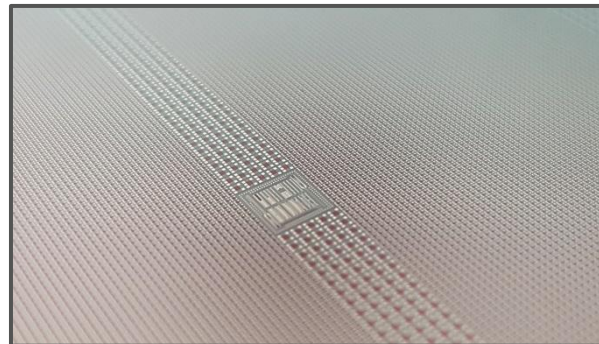
In zunehmendem Maße sind Fragen der Langzeitstabilität, des Einsatzes unter rauen Einsatzbedingungen sowie einer innovativen Aufbau- und Verbindungstechnik relevant.



Automatisches Handling von Chips

Ziele

Das Ziel der Veranstaltung ist es, aktuelle Ergebnisse aus Forschung, Entwicklung und Anwendung für siliziumbasierte MEMS-Sensoren vorzustellen. Dabei wird der Bogen von neuen Material wie SiCER bis zur den verschiedensten Anwendungen gespannt. Beleuchtet wird die Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen bis hin zur messtechnischen Charakterisierung.



Dehnmessstreifen

Agenda

9:00 Registrierung & Get together

Eröffnung & Überblick

9:30 Begrüßung
Prof. Thomas Ortlepp, CiS Forschungsinstitut

SESSION I - Si-DMS für Industrie 4.0

9:40 Si-DMS und ihre Anwendungen
Andrea Cyriax, CiS Forschungsinstitut

10:10 RFID-Datenübertragung bei MEMS-Sensoren
Dr. Reinhard Jurisch, Micro-Sensys GmbH

10:40 Pause

SESSION II - Miniaturisierte Kraftsensoren-vom Design zur Technologie

10:55 Aspekte bei der Entwicklung kundenspezifischer Drucksensoren
Sebastian Pobering, CiS Forschungsinstitut

11:25 Temperaturmessung für die Industrie 4.0
Dr. Ingo Tobehn-Steinhäuser, CiS Forschungsinstitut

11:55 Trends der Temperaturmessung für den Automotive Bereich
Dr. Thomas Rödiger, AB elektronik Sachsen GmbH

12:25 Pause

SESSION III - neue Sensormaterialien designen und charakterisieren

13:10 Microstructure transformation of silicon Microstructures -MSTS
Stefan Völlmeke, CiS Forschungsinstitut

13:40 Messtechnische Charakterisierung von Sensoren
Stefan Jagomast, CiS Forschungsinstitut

14:10 SiCer ein innovatives Verbundmaterial für Sensoren
Beate Capraro, Fraunhofer -Institut für Keramische Technologien IKTS

14:40 MEMS-Sensoren für die Gravimetrie
Robert Täschner, CiS Forschungsinstitut

ab 15:10 Networking & Get together